Ni₇₈Fe₂₂/Mq₃(M = Al, Er)/Ni₇₈Fe₂₂ナノ接合素子における

室温磁気抵抗効果

千秋賀英子*、佐々木悠馬**、中山雄介*、三澤貴浩**、小峰啓史***、星野哲久****、 芥川智行****、藤岡正弥**、西井準治**、海住英生*·****

(*慶大理工、**北大電子研、***茨大工、****東北大多元研、*****慶大スピンセンター)

 $Room\ temperature\ magnetoresistance\ effect\ in\ Ni_{78}Fe_{22}/Mq_3 (M=Al,\ Er)/Ni_{78}Fe_{22}\ nanoscale\ junctions$

K. Senshu*, Y. Sasaki**, Y. Nakayama*, T. Misawa**, T. Komine***, N. Hoshino****,

T. Akutagawa****, M. Fujioka**, J. Nishii** and H. Kaiju******

(*Keio Univ., **Hokkaido Univ. RIES, ***Ibaraki Univ.,

****Tohoku Univ. IMRAM, *****Keio Univ. CSRN)

<u>はじめに</u>

分子スピントロニクスデバイスでは、スピン軌道相互作用(SOI)、及び超微細相互作用(HFI)が弱い分子材料 を選択することにより、長いスピンコヒーレンス長、及び大きな磁気抵抗(MR)効果の実現が期待できる[1,2]。 本研究では、磁性薄膜エッジを利用した分子ナノ接合作製手法[3]を用いることでNi₇₈Fe₂₂/Mq₃(M = Al, Er, q = 8-hydroxyquinolinato)/Ni₇₈Fe₂₂ナノ接合素子を作製し、電気伝導特性、及び磁気抵抗効果を調べた。

<u>実験方法</u>

Ni₇₈Fe₂₂薄膜電極の作製にはイオンビームスパッタ法、熱圧 着法、及び化学機械研磨法を用いた。分子の成膜にはスピンコ ーティング法を用いた。これにより図1の挿入図に示すナノ接 合素子を作製した。素子の電気磁気特性評価には磁場中直流四 端子法、及び集光型磁気光学カー効果法を用いた。

<u>実験結果</u>

図1にNi₇₈Fe₂₂/Alq₃/Ni₇₈Fe₂₂素子における抵抗の接合面積依 存性を示す。計算結果との比較により、電気伝導特性には接合 面積に対応して量子状態、古典状態、及びそれらの遷移状態が 存在することが明らかになった。図2(a)に低抵抗を示したナノ 接合(接合面積 $S = 33 \times 33$ nm²)の MR 効果を示す。室温にて MR 効果の観測(MR 比=0.3%)に成功した。図2(b)に Ni₇₈Fe₂₂/Erq₃/Ni₇₈Fe₂₂素子の MR 効果を示す。MR 比は 0.7%を 示し、Ni₇₈Fe₂₂/Alq₃/Ni₇₈Fe₂₂素子の MR 比よりも2倍程度大き くなることがわかった。実験結果は Julliere モデルによる計算 結果と良い一致を示した。Al の核スピンが 5/2 であることに対 し、Er の核スピンは0 であることから、HFI が小さい Erq₃を 用いることが大きな MR 比の観測に至ったと考えられる。

<u>参考文献</u>

- [1] C. Barraud et al., Nat. Phys. 6, 615 (2010).
- [2] X. Zhang et al., Nat. Commun. 4, 1392 (2013).
- [3] T. Misawa et al., Appl. Surf. Sci. 390, 666 (2016).



図1Ni₇₈Fe₂₂/Alq₃/Ni₇₈Fe₂₂接合素子における 抵抗の接合面積依存性



図2 室温でのNi₇₈Fe₂₂/Mq₃/Ni₇₈Fe₂₂接合素子 (S = 33×33 nm²)の磁化曲線と MR 効果 ((a)M = Al、(b)M = Er)